



Torino, 21 ottobre 2019

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD)

CIG 796950211A - CID 321-15 - CUP E15D18000350007 - CUI F00518460019201900102

Convocazione IV Seduta pubblica

Si comunica che il giorno **25 ottobre 2019 alle ore 14,30** presso la saletta B, sita al primo piano dell'Ateneo in C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, si terrà la quarta seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle Buste C contenenti l' "Offerta economica".

Ufficio Appalti